

精密イオンポリッシングシステム (PIPS) Model 691

製造元	Gatan, Inc. (米国)
仕様	使用ガス： アルゴン 加速電圧： 1~6 kV
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・1階 118室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 鹿住健司 075-753-5474 kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp
キーワード	イオンミリング、試料作製、平面ミリング、TEM、SEM
機器コード	0000103012
自由記入欄	アルゴンイオンビームを試料に照射し表面の原子を弾き飛ばして試料を削ることで、TEM (透過電子顕微鏡) 観察が可能な薄膜試料を作製できるイオンミリング装置である。本装置を用いる前の工程として機械研磨とディンプリングを行う必要がある。SEM 観察のための平面ミリングを行うこともできる。

